

СТРУКТУРНЫЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ (100), ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ ЖИДКОФАЗНОЙ ЭПИТАКСИИ

© 2005 Э.П. Домашевская¹, П.В. Середин¹, А.Н. Лукин¹, Л.А. Битюцкая¹,
К.С. Борщев^{1,2}, М.В. Гречкина¹, И.Н. Арсентьев²

¹Воронежский государственный университет

²Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

Поступила в редакцию 05.07.05

Совокупность структурных, спектральных и морфологических исследований, проведенных с использованием рентгеновской дифрактометрии, ИК-решеточной спектроскопии на отражение и атомно-силовой микроскопии, свидетельствует о структурной устойчивости твердых растворов $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ в области составов $x \sim 0.50$ эпитаксиальных гетероструктур, выращенных методом жидкофазной эпитаксии.

ВВЕДЕНИЕ

Большой интерес у исследователей вызывают явления, связанные с возникновением упорядоченных структур в эпитаксиальных слоях твердых растворов полупроводниковых соединений A^3B^5 , являющихся основными исходными материалами для компонентов микро и наноэлектронных устройств.

Так ряд работ в этой области [1-4] акцентирует внимание на проблемах анализа твердых растворов $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ в области $x \sim 0.50$ ввиду их структурной неустойчивости, сопровождающейся образованием областей упорядочения в виде сверхструктурных фаз.

Актуальность проблемы упорядочения связана с модификацией фундаментальных свойств полупроводниковых систем, обусловленной понижением симметрии сфалеритной структуры соединений A^3B^5 , следствием которого является возможное изменение ширины запрещенной зоны, переход от непрямозонного к прямозонному полупроводнику, инверсному порядку следования зон, усложнению XANES и ИК-спектров сверхструктурных фаз в результате снятия вырождения с состояний, соответствующих потолку валентной зоны и дну зоны проводимости.

В нашей предыдущей работе [5] представлены результаты исследования эпитаксиальных гетероструктур $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ (100), выращенных методом МОС - гидридной эпитаксии. Методами рентгеновской дифракции было установлено, что в эпитаксиальных твердых растворах с $x=0.50$ и $x=0.54$ появляется фаза упорядочения AlGaAs_2 , являющаяся сверхструктурой к решетке сфалерита. Решетку обнаруженной фазы AlGaAs_2 можно описать слоистой структурой InGaAs_2 -типа (Layered Tetragonal) [6] с направлением упорядочения [100]. В этой структуре элементарная ячейка соответствует двум ячейкам типа сфалерита, поставленным друг на друга вдоль оси с, перпендикулярно к которой расположены чередующиеся слои Al – As и Ga – As. Величина тетрагонального сжатия $c/2a$ составляет в сверхструктуре величину, равную 0.97.

Целью данной работы явился анализ возможной структурной неустойчивости твердых растворов гетероструктур $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ (100), полученных методом жидкофазной эпитаксии, в области составов, близких к $x=0.50$. Однако следует отметить, что среди основных методов эпитаксии: молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ), хими-

ческого осаждения из газовой фазы (к которому относится и МОС-гидридная эпитаксия) и жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ), последняя является наиболее равновесным способом получения эпитаксиальных слоев. Поэтому образование сверхструктурных фаз упорядочения, во многом обусловленное процессами самоорганизации, в случае жидкофазной эпитаксии представляет наименее вероятным. Для сопоставления структурных, спектральных и морфологических характеристик эпитаксиальных гетероструктур $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ (100), полученных двумя разными методами: МОС-гидридной [5] и ЖФ эпитаксии, в данной работе нами были предприняты исследования жидкофазных эпитаксиальных гетероструктур $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ (100), методами рентгеновской дифрактометрии, ИК-спектрометрии на отражение и методами зондовой микроскопии с использованием атомно-силового микроскопа.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе исследовались гетероструктуры, изготовленные в ФТИ имени А.Ф. Иоффе РАН. На монокристаллических подложках GaAs (100) методом жидкофазной эпитаксии были выращены монокристаллические пленки $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ различной толщины. Технологические данные относительно толщин слоев эпитаксиальных твердых растворов гетероструктур $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ (100) и содержания в них Al по данным микроанализа приведены в таблице 1.

Все дифрактометрические исследования в данной работе проводились на дифрактометре ДРОН-3 с рентгеновским $\text{Cu}_{\text{K}\alpha_{1,2}}$ излучением.

ИК - решеточные спектры отражения от исследуемых эпитаксиальных гетероструктур получали при комнатной температуре в интервале от 200 до 600 cm^{-1} с помощью ИК-спектрометра Specord-82 M, сопряженного с ЭВМ и имеющего разрешение в 1 cm^{-1} .

Морфологию поверхности МОС - гидридных эпитаксиальных слоев $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ от гетероструктур исследовали на сканирующем зондовом микроскопе Femtoscan-001 в атомно-силовом режиме с кантилевером CSC 12 в режиме AFM.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Измерение параметров решетки дифрактометрическим методом

Для определения постоянной решетки твердых растворов a^* с учетом упругих напряжений в гетероэпитаксиальном слое методами рентгеновской дифракции измеряют ее перпендикулярную составляющую a^\perp [1]. Определение параметров эпитаксиальных пленок $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ производилось по линии (400). Для вычисления постоянных решеток твердых растворов a^* коэффициенты Пуассона были взяты из литературных данных: $v_{\text{AlAs}} = 0.255$ [1,2], $v_{\text{GaAs}} = 0.312$ [7].

Разложение дифракционных линий на компоненты проводилось по методике, описанной в [5] с использованием программы регрессивного анализа Sigma Plot 9. Для раз-

Таблица 1

Характеристики исследуемых гетероструктур

N	Состав эпитаксиальной гетероструктуры	x	μ , мкм	$a^*_{\text{эксп}}$, \AA	a^* , \AA [8]
1	$\text{Al}_{0.17}\text{Ga}_{0.83}\text{As}/\text{GaAs}$ (100)	0.17	6	5.654	5.655
2	$\text{Al}_{0.37}\text{Ga}_{0.63}\text{As}/\text{GaAs}$ (100)	0.37	1.6	5.656	5.656
3	$\text{Al}_{0.49}\text{Ga}_{0.51}\text{As}/\text{GaAs}$ (100)	0.49	1.6	5.656	5.657
4	$\text{Al}_{0.57}\text{Ga}_{0.43}\text{As}/\text{GaAs}$ (100)	0.57	1.5	5.656	5.658
5	$\text{Al}_{0.71}\text{Ga}_{0.29}\text{As}/\text{GaAs}$ (100)	0.71	0.9	5.658	5.659
6	GaAs (100)			5.654	5.653

СТРУКТУРНЫЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ (100), ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ ЖИДКОФАЗНОЙ ЭПИТАКСИИ

ложения использовался (400) $\text{K}_{\alpha_{1,2}}$ -дублет монокристаллической пластины GaAs (100). Результаты разложения (400) линии на $\text{K}_{\alpha_{1,2}}$ -дублеты показали (табл. 1) и (рис. 1, а – 1, е), что дифракционные профили (400) – линий всех образцов являются наложением дифракций от эпитаксиального слоя $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ и от подложки GaAs (100). По результатам раз-

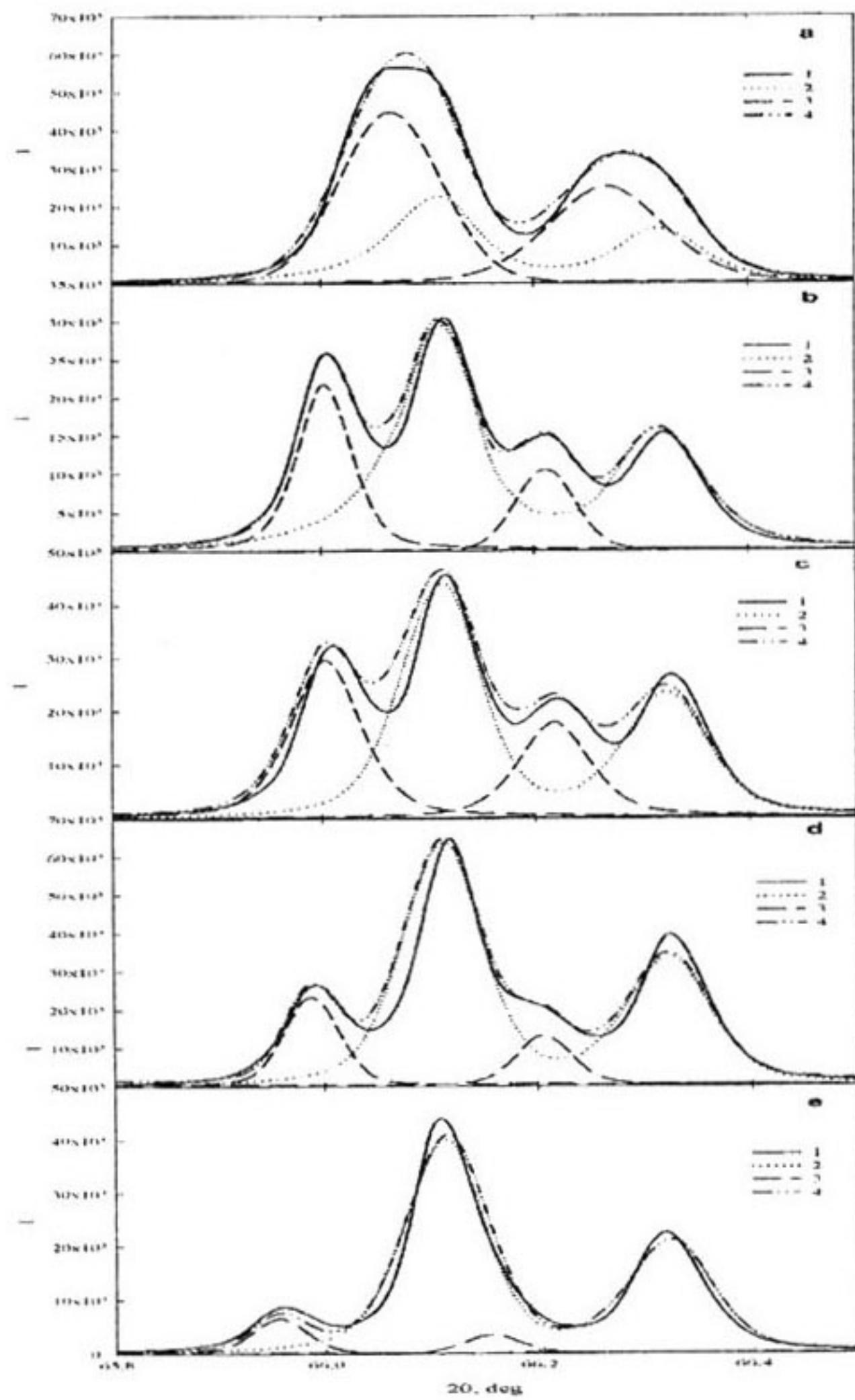


Рис. 1. Разложение профилей дифракционных линий (400) эпитаксиальных гетероструктур $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ (100): 1 – экспериментальный профиль, 2 – $\text{K}_{\alpha_{1,2}}$ дифракционный дублет GaAs (100); 3 – дифракция от твердого раствора $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$, 4 – аппроксимация
 (а) гетероструктура $\text{Al}_{0.17}\text{Ga}_{0.83}\text{As}/\text{GaAs}$ (100),
 (б) гетероструктура $\text{Al}_{0.37}\text{Ga}_{0.53}\text{As}/\text{GaAs}$ (100),
 (в) гетероструктура $\text{Al}_{0.49}\text{Ga}_{0.51}\text{As}/\text{GaAs}$ (100),
 (г) гетероструктура $\text{Al}_{0.57}\text{Ga}_{0.43}\text{As}/\text{GaAs}$ (100),
 (е) гетероструктура $\text{Al}_{0.71}\text{Ga}_{0.29}\text{As}/\text{GaAs}$ (100).

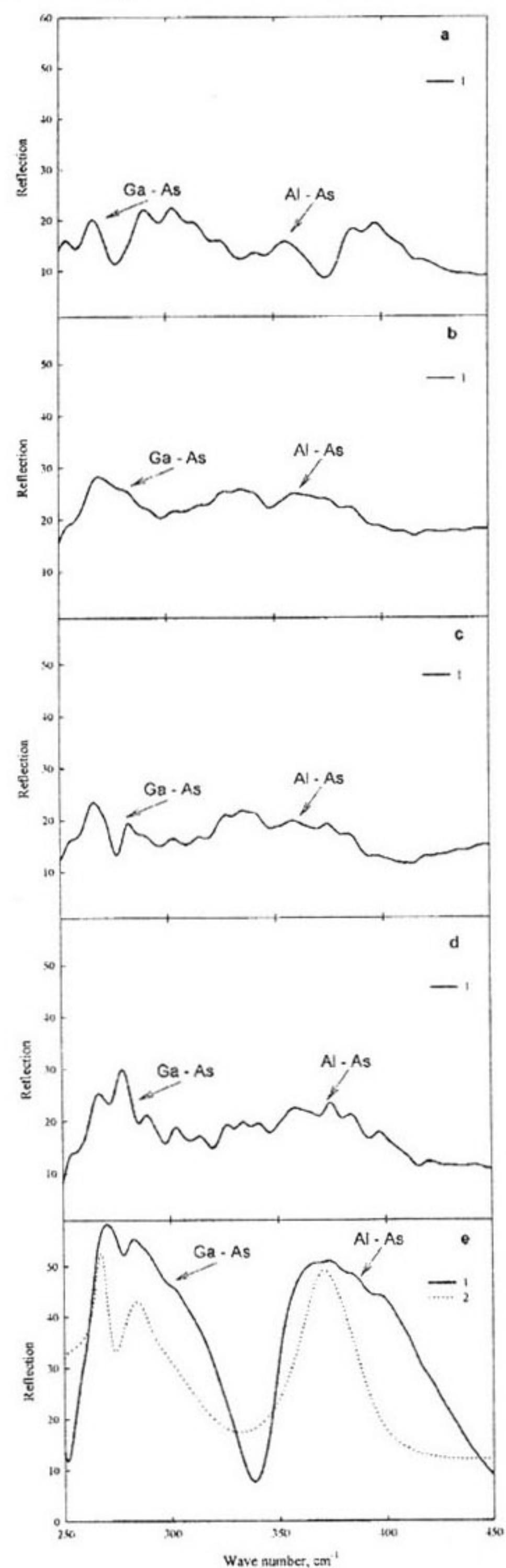


Рис. 2. ИК – спектры отражения GaAs (100) и эпитаксиальных гетероструктур $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ (100): 1 – эксперимент, 2 – расчет;
 (а) гетероструктура $\text{Al}_{0.17}\text{Ga}_{0.83}\text{As}/\text{GaAs}$ (100),
 (б) гетероструктура $\text{Al}_{0.37}\text{Ga}_{0.53}\text{As}/\text{GaAs}$ (100),
 (в) гетероструктура $\text{Al}_{0.49}\text{Ga}_{0.51}\text{As}/\text{GaAs}$ (100),
 (г) гетероструктура $\text{Al}_{0.57}\text{Ga}_{0.43}\text{As}/\text{GaAs}$ (100),
 (е) гетероструктура $\text{Al}_{0.71}\text{Ga}_{0.29}\text{As}/\text{GaAs}$ (100).

ложения на компоненты были определены параметры кристаллических решеток твердых растворов $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ с точностью $\pm 0.001 \text{ \AA}$, которые приведены в таблице 1 вместе со значениями параметров, ожидаемых в соответствии с линейным законом Вегарда, приведенном на сайте ФТИ РАН [8].

2. ИК-спектры отражения колебаний решетки

На рисунках 2,а – 2,е приведены экспериментальные спектры эпитаксиальных гетероструктур $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}(100)$ с малым, большим и близким к половинному содержанием Al в металлической подрешетке. Как видно из рисунка 2, только ИК - спектр решеточного отражения образца с $x=0.71$ содержит две моды колебаний, отвечающие связям Al – As и Ga – As что соответствует литературным данным [9-10]. В спектрах остальных образцов помимо мод, относящихся к связям Al – As и Ga – As, присутствуют дополнительные моды различной интенсивности, расположенные как между основными колебаниями, так и смещенные

в длинно- и коротковолновую части спектра относительно основных колебаний.

Дисперсионный анализ спектра образца с $x=0.71$, проведенный по методике пленка – подложка [11], показал, что использование данной модели к этому спектру не дает хорошего совпадения с экспериментом из-за значительного уширения мод колебаний экспериментального спектра. Для остальных образцов проводить дисперсионный анализ не имело смысла ввиду плохого качества спектров, которое может быть обусловлено дефектами поверхности слоев, выращенных методом ЖФЭ.

На рисунках 3 и 4 приведены результаты морфологических исследований методом зондовой микроскопии: (а) - изображения характерных микроучастков двух образцов; (б) - сечения их поверхности; (с) - соответствующие функции распределения рельефа поверхности для эпитаксиальных гетероструктур с различным содержанием Al в твердом растворе $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$, в том числе и с близким к половинному составу ($x=0.49$).

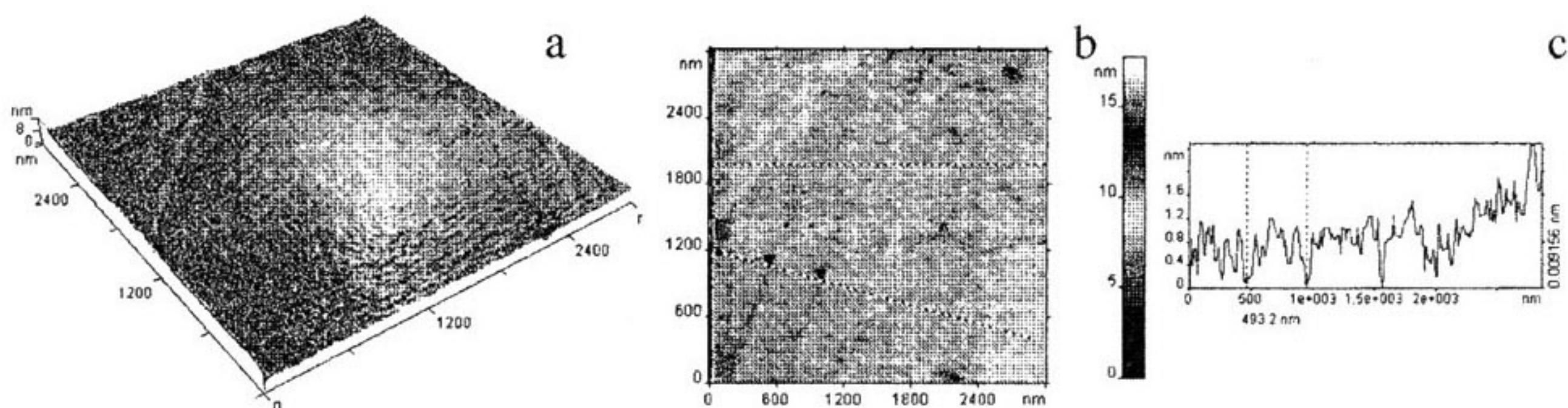


Рис. 3 Изображение участка поверхности ($2.5 \times 2.5 \text{ мкм}^2$) и функция распределения рельефа поверхности гетероструктуры $\text{Al}_{0.37}\text{Ga}_{0.63}\text{As}/\text{GaAs}(100)$.

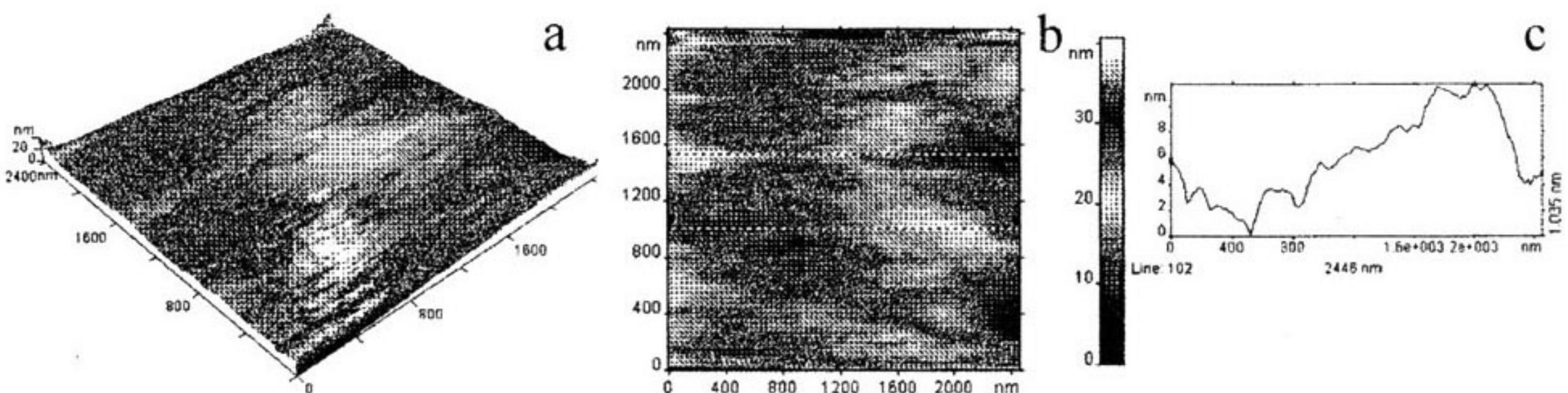


Рис. 4 Изображение участка поверхности ($2.5 \times 2.5 \text{ мкм}^2$) и функция распределения рельефа поверхности гетероструктуры $\text{Al}_{0.49}\text{Ga}_{0.51}\text{As}/\text{GaAs}(100)$.

Из рисунков видно, что образцы имеют шероховатую поверхность, с углублениями, достигающими 10 нм. Такое несовершенство морфологии поверхности приводит к плохому качеству ИК-спектров отражения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значения параметров решетки a^* жидкофазных эпитаксиальных твердых растворов $Al_xGa_{1-x}As$ различных составов, определенные с учетом упругих напряжений, удовлетворяют линейному характеру зависимости параметра решетки от состава твердого раствора в системе AlAs-GaAs, приведенному в [5 и 8].

Данные ИК спектрометрии отражения показали, что в спектрах жидкофазных эпитаксиальных гетероструктур $Al_xGa_{1-x}As/GaAs$ (100) с различными концентрациями Al в металлической подрешетке, несмотря на плохое отражение поверхностью, все же присутствуют основные моды колебаний Ga – As и Al – As. Появление дополнительных мод и уширение линий спектра связано с тем, что на поверхности образцов присутствует большое количество микроскопических дефектов и неровностей, что подтверждают данные атомно-силовой микроскопии.

Сверхструктурная фаза $AlGaAs_2$, обнаруженная в ходе аналогичных исследований МОС-гидридных гетероструктур $Al_xGa_{1-x}As/GaAs$ (100) с $x \sim 0.50$, не наблюдалась ни одним из методов в образцах близкого состава, полученных жидкофазной эпитаксией.

Таким образом, совокупность структурных, спектральных и морфологических исследований свидетельствует о структурной устойчивости твердых растворов $Al_xGa_{1-x}As$ в области составов $x \sim 0.50$ эпитаксиальных гетероструктур, выращенных методом жидкофазной эпитаксии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. D. Zhou and B.F. Usher. Deviation of the AlGaAs lattice constant from Vegard's law // J. Phys. D: Appl. Phys. 2001. V. 34. P. 1461-1465.
2. Z.R Wasilewski, M.M Dion, D.J Lockwood, P Poole, R.W. Streater and A J. Spring Thorpe. Composition of AlGaAs // J. Appl. Phys. 1997. V. 81. P. 1683-1694.
3. S. Gehrsitz, H. Sigg, N. Herres, K. Bachem, K. Kohler and F.K. Reinhart. Compositional dependence of the elastic constants and the lattice parameter of $Al_xGa_{1-x}As$ // Phys. Rev. B. 1999. V. 60. № 11. P. 601-611.
4. T.S. Kuan, T.F. Kuech, W.I. Wang. Long-Rang Order in $Al_xGa_{1-x}As$ // Phys. Rev. Lett. 1985. V. 54. P. 201.
5. Э.П. Домашевская, П.В. Середин, Э.А. Долгополова, И.Е. Занин И.Н. Арсентьев, Д.А. Бунокуров, А.Л. Станкевич, И.С. Тарасов. Закон Вегарда и сверхструктурная фаза в эпитаксиальных гетероструктурах $Al_xGa_{1-x}As/GaAs$ (100) // ФТП. 2005. Т. 3. С. 354-360.
6. Alex Zunger. MRS-IRS bulletin/ July 1997. <http://www.sst.nrel.gov/images/mrs97>
7. Adachi S. GaSa, AlAs, and $Al_xGa_{1-x}As$: Material parameters for use in research and device applications// J. Appl. Phys. 1985. V. 58. R1-29
8. Сайт РФТИ им. Иоффе С-Пб. Характеристики новых полупроводниковых материалов. www.ioffe.ru
9. M. Illegems, G.L. Pearson. Infrared reflection spectra of $Ga_xAl_{1-x}As$ mixed crystals // Phys. Rev. B. 1970. V. 1. № 4. P. 1576-1582.
10. I. F. Chang, S.S. Mitra. Optical phonons in $Ga_xAl_{1-x}As$ mixed crystals. // Phys. Rev. B. 1970. V. 2. № 4. P. 1215-1216.
11. H.W. Verleur. Determination of Optical Constant from Reflectance or Transmittance Measurements on Bulk // JOSA. 1968. V. 58. P. 1356.